科学研究費補助金研究成果報告書

平成22年5月21日現在

研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2007~2009 課題番号:19560740 研究課題名(和文) 微視的反応浸透による金属間化合物厚膜の整列多孔質組織の形成機構 研究課題名(英文) Formation mechanism of aligned microporous structures in the intermetallic thick films produced by microscopic reactive infiltration 研究代表者 大参 達也 (OHMI TATSUYA) 北海道大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:90169061

研究成果の概要(和文): Ni と Al を用いた粉末冶金的なマイクロチャンネル形成プロセスによって作製されたマイクロチャンネルの内壁には、しばしば特異な整列多孔質組織を持った金属間化合物厚膜が形成する。本研究は、粉末成形体の初期気孔率が特定の範囲にある場合にこの組織が形成する事を見出した。また、この組織が二つの異なる機構、すなわちアルミニウム融液への金属間化合物の擬等温的な凝固とニッケル粉末領域へのアルミニウムの反応拡散によって形成することを明らかにした。

研究成果の概要(英文): An intermetallic thick film with a peculiar aligned microporous structure often forms on the inner wall of the microchannel produced by a powder-metallurgical microchanneling process using nickel and aluminum. In this study, it was found that such a porous structure formed when the initial porosity of the powder compact was within a specific rage. It was also revealed that this structure was produced by two different mechanisms: pseudo-isothermal solidification of intermetallic compounds into the aluminum pool and solid state reactive diffusion of aluminum into the nickel powder region.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2007年度	1, 700, 000	510, 000	2, 210, 000
2008年度	900, 000	270, 000	1, 170, 000
2009年度	1, 000, 000	300, 000	1, 300, 000
年度			
年度			
総計	3, 600, 000	1, 080, 000	4, 680, 000

研究分野:工学 科研費の分科・細目:材料工学・金属生産工学 キーワード:融体・凝固

1.研究開始当初の背景 様々な環境問題への対応、あるいは新たな 資源・エネルギー体系の構築において、触媒 技術は重要な基盤技術となっている。また、 触媒技術の開発において、希少金属を代替す る新たな触媒材料の探索とともに、触媒を高 効率で機能させる触媒担体の開発が不可欠 となっている。

一方、金属系のマイクロリアクターは耐熱 性と機械的強度を兼ね備え、とりわけ高い熱 伝導率ゆえに、急速な加熱冷却や厳密な温度 制御を可能にすることから、触媒反応に適し ている。したがって、簡便なプロセスによっ て金属デバイス内にマイクロチャンネルを 形成し、さらにその内壁を高い比表面積を有 する触媒担体で内張することができれば、環 境技術の進展にもたらす寄与は大きい。

本研究者は、既に、粉末冶金的なマイクロ チャンネル形成プロセスにおいて、製品本体 を構成する基体金属と空隙形状を与える犠 牲コア金属の組み合わせとしてNiとAlを用 いた場合に、マイクロチャンネル内壁に形成 するNiAl金属間化合物厚膜が特異な整列多 孔質組織を持つ例があることを見出してい た。この厚膜は、犠牲コアの形状によって任 意の形状に制御することが可能であり、また、 金属間化合物NiAlは耐熱性、耐食性、耐酸 化性に優れており、触媒担体材料として適し ている。しかし、このような特異な整列多孔 質組織の形成については、これまで研究例が 無く、具体的機構は不明であり、組織制御の 指針も存在しなかった。

2. 研究の目的

以下の項目の調査に基づいて、Ni-Al 系金 属間化合物厚膜の整列多孔質組織の形成機 構を解明し、組織制御指針を確立することを 目的とした。

(1) 整列多孔質組織の形成するプロセス条件の探索。

(2) Ni 粉末に替えて、間隙の幾何学的形状を 制御しやすい Ni 線および内部に空隙を持た ない Ni バルクを用いたモデル実験。

(3) 犠牲コアへの第3元素添加の影響の調査。

(4) 焼結熱処理過程での組織凍結による組織 形成過程の追跡。

3. 研究の方法

(1) Ni 粉末に Al 線(直径 50~500 µm)を埋め込み、円柱状の粉末成形体を作製した。粉末成形体の気孔率 Eを変化させ、整列多孔質組織の形成条件を調査した。

(2) 基体金属として、Ni 粉末に代えて、Ni 線および Ni バルクを用いたモデル実験を実 施した。

(3) 別途開発した金属粉末製犠牲コアを用いる自由形状マイクロチャンネル形成プロ

セスを用い、金属間化合物厚膜の組織形成に 及ぼす第3元素の影響を調査した。本プロセ スでは、合金粉末や混合粉末を有機バインダ と混合して可塑性または流動性を有するコ ンパウンドとし、これを成形して犠牲コアと する。犠牲コア金属としてA1粉末、A1-Cu合 金粉末、A1-Cu混合粉末およびA1-Si合金粉 末を検討した。

(4) 粉末成形体の焼結熱処理過程において、 所定の温度で試料をウッドメタル浴に浸漬 することにより急冷し、組織を凍結した。得 られた試料に対して、光学顕微鏡観察、SEM 観察、および EPMA 組成分析による金属組織 学的調査を実施した。

4. 研究成果

(1) 整列多孔質組織の形成に影響を及ぼす プロセス因子として粉末成形体の気孔率に 注目し、種々の気孔率を有する粉末成形体試 料を用いて実験を行った結果、気孔率 24%~ 32%の粉末成形体を使用した場合、膜厚方向 に長く成長した細孔が整列分布する多孔質 組織が形成した(図1(b)(c)参照)。一方、粉 末成形体の気孔率が低過ぎる場合には、不定 形に拡がった反応生成物領域が形成し、多孔



図1 マイクロチャンネル近傍の組織 気孔率 E: (a)36.0%, (b)29.8%, (c)23.6%

質組織にはならないことが明らかになった (図1(a)参照)。

図2に、厚膜内の細孔の平均体積率に及ぼ す粉末成形体の気孔率の影響を示す。細孔体 積率は粉末成形体気孔率が30%の時に最大と なった(犠牲コア線径200μmのとき60%、500 μmのとき46%)。



図 2 細孔体積率 *ε* に及ぼす粉末成形体 気孔率 *E*の影響

本結果は、触媒担体に適した多孔質金属間 化合物厚膜を製造する上で重要な指針を与 えるものである。

次に、焼結熱処理工程の途中の各段階で粉 末成形体試料をウッドメタル浴に浸漬・急冷 して、組織を凍結する実験を行い、マイクロ チャンネルと金属間化合物厚膜の形成過程 を調査した。

まず、図 1(a)の試料と同じ気孔率(36%) を有する粉末成形体を用いた組織凍結実験 では、A1 融点近傍において Ni 粉末粒子を起 源とする有核組織が観察された。この組織は 典型的な浸透現象の痕跡である。

一方、整列多孔質厚膜が形成する条件では、 厚膜は、A1の溶解後、A1とNi粉末領域の界 面において比較的速やかに形成したが、A1融 液自体は長時間に渡ってその場に留まって おり、反応浸透によるマイクロチャンネルの 形成には時間を要した。この結果は、Ni-A1 系においては厚膜を介して行われる物質輸 送が支配的であり、毛管現象によって A1 融 液が Ni 粉末間を浸透する典型的な浸透機構 がマイクロチャンネル形成をもたらしてい るわけではないことを示している。

(2) 金属間化合物厚膜の多孔質化に及ぼす Ni 粉末中の空隙の影響を明らかにする目的 で、Ni 粉末に替えて空隙の幾何学的形状を制 御しやすい Ni 細線で犠牲コア Al 線を包囲し たモデル試料を用いて焼結実験を実施した 結果、細孔を含まない均一な厚さの厚膜が形 成した。加工硬化した Ni 線は圧縮成形に際 しても変形しにくく、線の間隙形状が保持されたため、反応浸透が容易に行われた結果、 緻密な厚膜が形成したものと推察された。この結果は、反応浸透が妨げられることにより 整列多孔質組織が形成することを示唆している。一方、Niバルクに穴を開けてAl線を 挿入して熱処理をしたモデル実験では、マイ クロチャンネルも多孔質厚膜も形成しなかった。

(3) 厚膜の組織に及ぼす第3元素添加の影 響を調査するために実施した自由形状マイ クロチャンネル形成実験では、犠牲コア金属 として A1 粉末を使用した場合、A1 細線を犠 牲コアとして用いた場合と同様の整列多孔 質組織を有する厚膜が形成した。さらに、 A1-33mass%Cu および A1-55mass%Cu 合金粉末 を用いた場合も組織的には大きな相違はみ られなかった。厚膜内の濃度測定の結果、A1 および Cu の傾斜的な濃度分布が確認された。 一方、A1 および Cu の混合粉末を用いた場合 は、細孔の膜厚方向への伸張が抑制される傾 向があり、また、Cu 拡散の遅れに起因して多 種類の Ni-Cu-Al 系金属間化合物が観察され た。また、Al-12mass%Si および Al-16mass%Si 合金粉末を用いた場合は、厚膜は粗大な粒子 の集合体のような組織を呈し、膜厚方向に長 く伸張した細孔は観察されなかった。以上の 結果は、犠牲コア金属の拡散過程が厚膜の多 孔質組織の形成に大きな影響を及ぼしてい ることを示唆している。

(4) 整列多孔質組織が形成する標準的な Ni 粉末成形体の焼結の途中で、①所定温度で急 冷する、②所定温度で所定時間温度保持を行 い急冷する等の組織凍結実験を実施し、厚膜 の形成過程を詳細に追跡した。その結果、以 下の結果を得た。

 比較的低温で形成する Al₃Ni₂ 金属間化 合物厚膜において既に整列多孔質組織が見 られた。

② Ni 粉末を基点とした Al 融液プール側へ の金属間化合物の擬等温凝固的な結晶成長 と、Ni 粉末側への反応拡散によって厚膜が形 成する。

③ 擬等温凝固的な結晶成長によりセル状の金属間化合物が形成し、その間隙が細長い細孔となる。

④ Ni 粉末側への反応拡散では、Ni 粉末間 の気孔の連続的な配列が優先的に引き継が れることによって細長い細孔が形成する。

⑤ 焼結時の昇温速度を上げることにより 直径 50 ミクロン程度の細いマイクロチャン ネルの形成が可能となる。これは、A1 融液中 の Ni 飽和濃度を急速に上昇させることによ って、チャンネル閉塞をもたらす擬等温凝固 的な結晶成長を抑制する効果による。 5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計2件)

① Naoya Hayashi, <u>Tatsuya Ohmi</u>, Manabu Iguchi: Structure of Ni-Al intermetallic porous thick films produced by microscopic reactive infiltration, Material Science Forum, Vols. 631-632 (2010), pp. 345-350. 査読有

② <u>Tatsuya Ohmi</u>, Naoya Hayashi and Manabu Iguchi: Formation of Porous Intermetallic Thick Film by Ni-Al Microscopic reactive Infiltration, Mater. Trans., 49 (2008), pp. 2723-2727. 査読有

〔学会発表〕(計11件)

① <u>T. Ohmi</u>, N. Hayashi, M. Iguchi: CONTROL OF POROUS STRUCTURE OF NICKEL-ALUMINIDE MICROCHANNEL LINING, 6th International Conference on Porous Metals and Metallic Foams (MetFoam2009), Bratislava (2009.9.2)

(2) Naoya Hayashi, <u>Tatsuya Ohmi</u> and Manabu Iguchi: Structure Control of Ni-Al Intermetallic Porous Thick Film Produced by Microscopic Reactive Infiltration, The 3rd International Symposium on Advanced Fluid/Solid Science and Technology in Experimental Mechanics (ISEM2008), Tainan, (2008. 12. 10)

③ Naoya Hayashi, <u>Tatsuya Ohmi</u>, Manabu Iguchi: Structure of Ni-Al intermetallic porous thick films produced by microscopic reactive infiltration, The 10th International Symposium on Multiscale, Multifunctional & Functionally Graded Materials, Sendai, (2008.9.22.24)

④ 林直哉, <u>大参達也</u>, 井口学: 微視的反応
 浸透による Ni-Al 系多孔質金属間化合物厚膜の形成条件, 日本実験力学会 2008 年度年次
 講演会, 札幌 (2008.7.2)

⑤ 林直哉,<u>大参達也</u>,井口学:微視的反応 浸透による Ni-Al 系多孔質金属間化合物厚膜 の形成,日本鉄鋼協会第 155 回春季講演大会, 東京,(2008.3.27) ⑥ <u>大参達也</u>,松浦清隆,井口学:微視的反応浸透によるマイクロチャンネル形成と機能性ライニング,日本実験力学会 2007 年度年次講演会,東京(2007.8.8)

⑦ 林直哉,<u>大参達也</u>,井口学: Ni-Al 系反応
 浸透による多孔質金属間化合物厚膜の形成
 条件.,日本金属学会 2007 年秋期(第 141 回)
 講演大会,岐阜(2007.9.20)

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 〇出願状況(計0件)

名称: 発明者: 権種類: 番 開 年 月 日: 国 内 外 の別:

○取得状況(計0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 日日: 国内外の別:

〔その他〕 ホームページ等

6.研究組織
 (1)研究代表者
 大参 達也 (OHMI TATSUYA)
 北海道大学・大学院工学研究科・准教授
 研究者番号:90169061

(2)研究分担者

()

研究者番号:

(3)連携研究者
()

研究者番号: